

A-010 複合ビーム加工観察装置 FIB-SEM

A-011 (日本電子 : JIB-4700F)

ガリウム線と電子線を操る複合ビーム加工観察装置です。

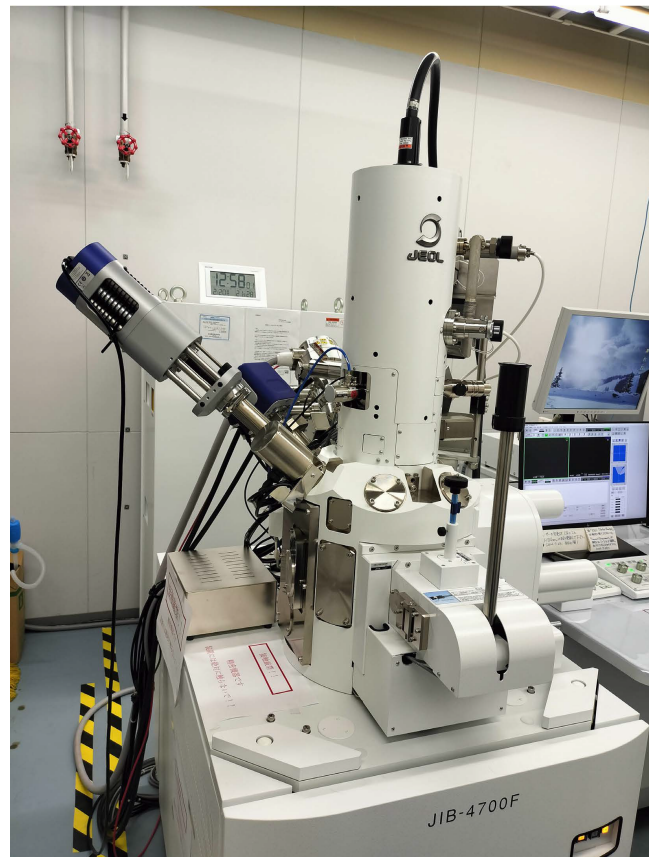
FIBは最大照射電流90nAの高電流密度Gaイオンビームを採用し、高速加工が可能です。

SEMは低加速条件で高空間分解能(1kV/1.6nm)を実現、大電流でも高い空間分解能を維持しています。

大口径EDS (エネルギー分散型X線分析装置)を導入しており、高速組成分析を行うことができます。

ナノマニピュレーター(OmniProbe350)が付属しています。SEMおよびFIBで観察しながらリフトアウト作業が行えるため、試料室内でTEM試料などの作製を完結させることができます。

大気非暴露トランスファーシステムを搭載しており、試料を大気に晒すことなく加工/取り出し/持ち運びが可能です。



設置場所 B5棟 1A-13

カテゴリー 加工/観察/分析